



从 50 mm 到 1 nm 的高精度测量

"简单易懂、瞬时、自动——"

新一代 VK 系列的功能性足以颠覆传统激光显微镜的形象。

### 新搭载

# 测量区域 传统产品的 16 倍

### 保证低倍率镜头的精度

实现传统激光显微镜难以达到的大范围微小形状测量。

### 新原理

# 测量时间 最快 5 秒

### Focus Variation ISO 25178-6

最快5秒即可完成测量。

### 新算法

# 全自动测量

### RPDII / AI 扫描

无需测量设定。放置后仅按一键即可准确测量微小形状。



### 激光显微系统进化史

1995 至



VK-8500









VK-X250

# 使用传统测量仪的困扰

光学显微镜、SEM



### ■焦点浅

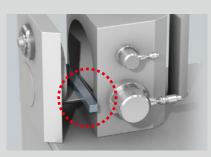


芯片电阻(100×)

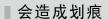
■倍率、颜色受限

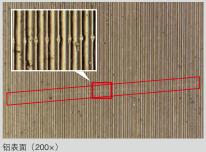


■目标物受限



粗糙度仪



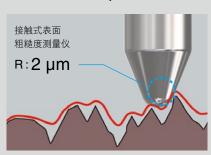


■角度特性低

■无法对准位置

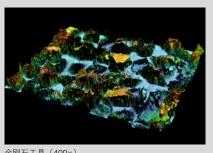


■尖端半径 2 µm



干涉仪



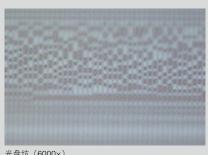


金刚石工具 (400×)

■需要进行倾斜调整

设置样品
焦点调节
倾斜调整
开始测量

■水平分辨率低



光盘坑(6000×)

# 如为激光显微镜





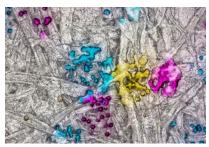
### 高分辨率彩色观察

### ■焦点深



芯片电阻(100×)

### ■彩色且最大 28800 倍



碳粉(1000×)

### ■空气中、非破坏

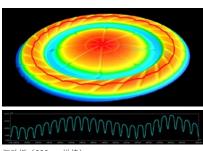


### 非破坏测量目标位置

### ■非接触测量

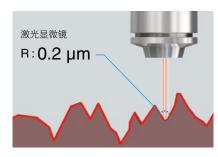


■ 可一边观察画面一边对准



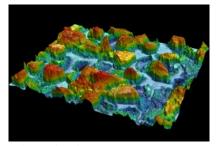
振动板(200×、拼接)

### ■ 光点半径 0.2 µm



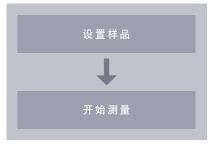
### 可测量各种目标物、高通用性

### ■角度特性高

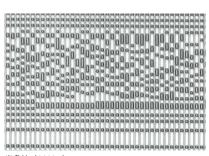


金刚石工具(400×)

### ■无需进行倾斜调整

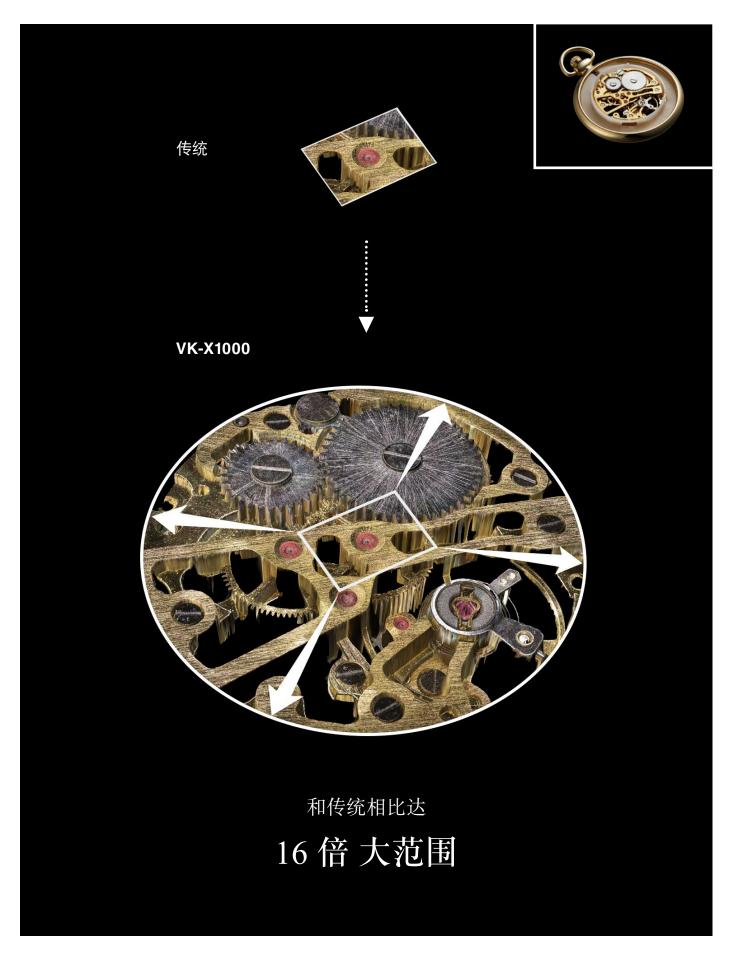


### ■水平分辨率高



光盘坑(6000×)

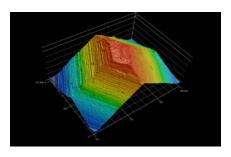
# 测量区域 传统产品的 16 倍



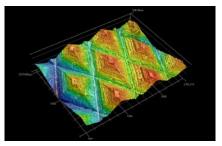
### 新搭载

# 保证低倍率镜头的精度\*

### 传统

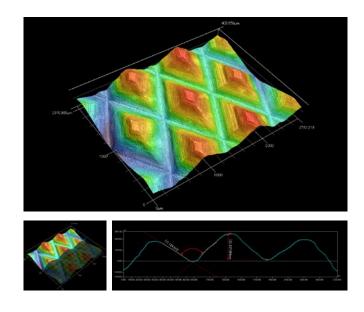


用高倍率镜头测量时, 精度高,但测量范围会变窄



用低倍率镜头测量时, 测量范围大,但精度会降低

### 如果 VK-X1000 精度高且范围大



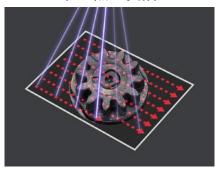
低倍率镜头下也能保证测量精度。陡峭的斜面、高低差较大的形状也能准确地 3D 化。以往 5 倍、10 倍的镜头只是用于寻找视野,但是今后可以用同样的视野直接进行测量。

# 测量时间 最快 5 秒

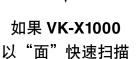


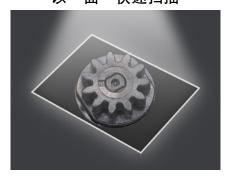
# 利用新原理实现"瞬间测量"

传统 以"点"扫描



约60秒



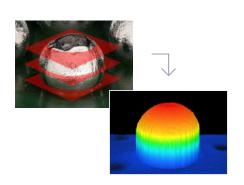


最快5秒

# 实现 12 倍的测量速度 Focus Variation \*ISO 25178-6

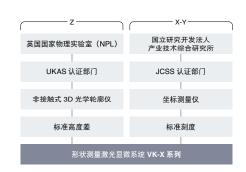
### 新原理 Focus Variation

在上下移动镜头的同时拍摄多张光学图像, 对焦点位置的高度进行拼接,从而构建出立体形状。



### 放心的精度保证

Focus Variation 的测量结果 基于符合国家标准的可追溯性系统。



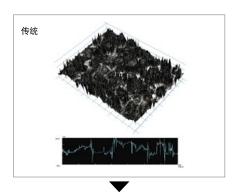
# 全自动测量

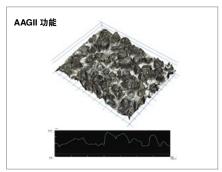


# 无需调整测量"AI-SCAN"

### 自动调整激光接收量 "AAGII 功能"

根据目标物对光接收量进行最佳化后, 即可对具有复杂微小形状或 不同材质的目标物实施准确测量。

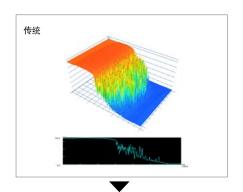


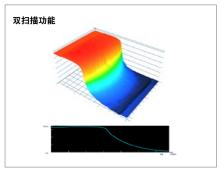


金刚石工具(400×)

# 2次扫描实现准确测量"双扫描功能"

单次扫描无法测量的情况下, 系统将自动改变光接收元件的灵敏度进行2次扫描, 从而进行准确的测量。



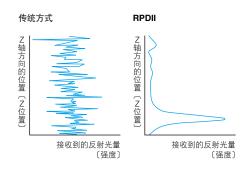


焊锡(100×)

# 全新光接收元件和新算法 ~ RPDII ~

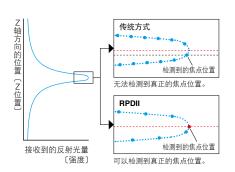
### 计算出准确的 ZI 曲线

刷新光接收元件和算法, 降低干扰。在暗处或低倍率镜头下 也可计算出准确的 ZI 曲线。



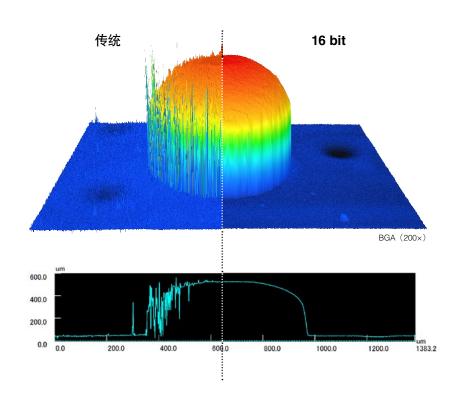
### 检测出准确的峰值

从 ZI 曲线中准确地检测出 反射光量最多的峰值位置。 如实地将立体形状 3D 化。



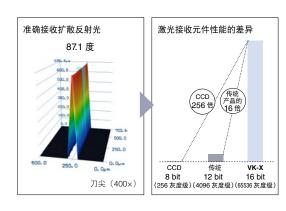
# 高精度 16 bit 感应

配备超高灵敏度光电倍增器,测量目标物的实际形状。



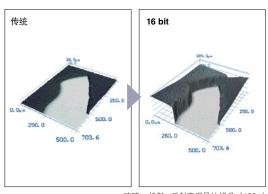
### 和传统相比达 16 倍的动态量程 对于陡角也可准确测量

对于具有陡角或复杂形状等难以测量的样品,或低倍率、 大范围下的测量等也可准确执行。



### 准确读取反射率不同的复合材料

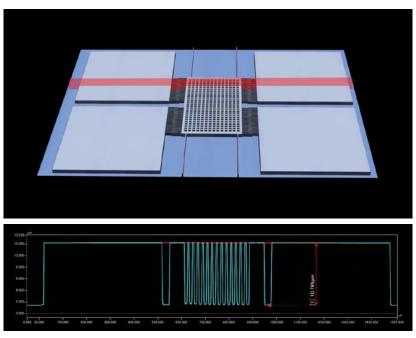
测量数据以 16 bit (65536 灰度级) 进行处理, 以往无法 看清的细微的颜色和明暗差异都可以如实地反映出来。



玻璃 + 橡胶: 反射率迥异的样品(400×)

# 准确进行纳米级别测量

### 领先的技术

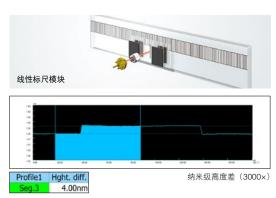


### MEMS 调节器(1000×)

提供:三田吉郎研究室(东京大学研究生院工学系研究科、纳米技术平台东京大学 VDEC 精细加工基地)

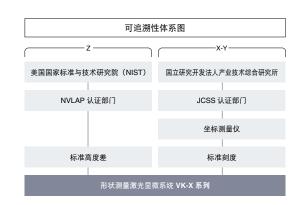
### 业界超高级别 0.5 nm 线性标尺

利用超高精度线性标尺,对物镜的 Z 轴移动量的控制精度可达 0.5 nm。实现了可读取纳米位数高度差的超高精度测量。



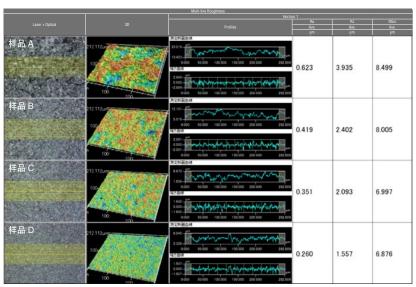
### 准确性、重复性双重精度保证

激光共聚焦测量基于符合国家标准的可追溯性系统,在 准确性和重复性两方面保证精度。



# 快速了解"差异"

### 利用多文件分析功能分析多个样品的差异



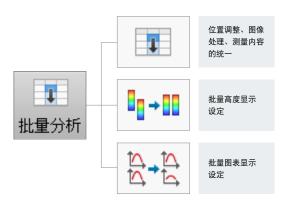
喷沙处理的表面粗糙度测量(1000×)

对于多个数据,可在 XYZ 的比例尺一致的状态下,以相同条件进行批量测量。可以在一瞬间发现由于生产条件改变或经时变化造成的"差异",缩短分析时间。

### 批量分析多个文件

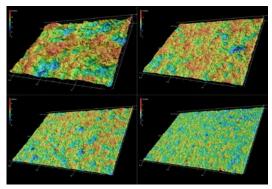
### Auto Arrange

使用 Auto Arrange,仅需一次操作即可批量处理所有数据。可消除因反复进行同一作业所产生的时间损失和设定错误等。



### 瞬时了解形状的"差异" 3D 一览显示功能

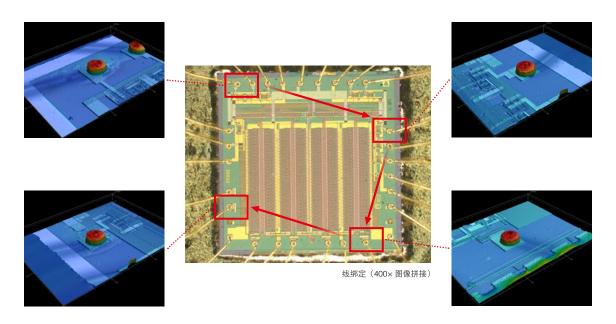
3D 形状也可以并列显示,在视觉上更容易比较多个样品。还可以将并列的状态保存为图像,以便向相关人员进行说明。



喷沙处理的表面腐蚀评估(1000×)

# 将常规的检查全自动 & 超高速化

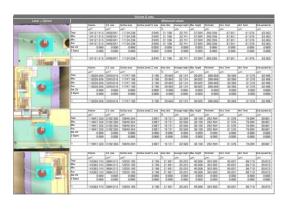
教学 & 批量测量



利用高水平的电动载物台控制,在指定的 XY 坐标位置自动执行测量。通过与特殊载物台组合,不仅可以增加用于分析的对象数量,还可以将检查工作完全自动化。

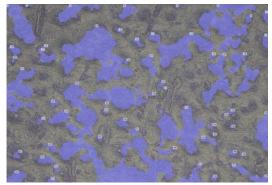
### 无需编程的简单设定自动分析体积、 尺寸、平面度等

可以对每个测量点适用 VK-X 具有的各种分析设定。无需专门的编程。依次测量体积、面积、外形尺寸和平面度等。



### 自动从整个视野中检测出符合条件的区域 对个数、面积率等进行批量测量

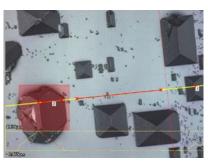
可根据距离基准面的高度以及各像素的颜色信息抽取特定的区域。瞬时计算出符合条件的区域的数量、体积以及占视野的面积率等。

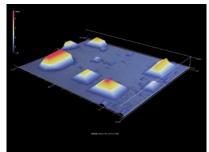


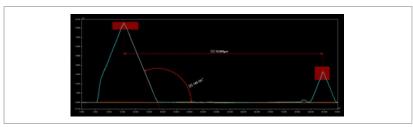
皱纹的面积率测量(200×)

# 目标位置的截面测量

### 非破坏、非接触测量目标位置的形状







由液相生成带来的 GaAs 方面的优点(3000×)

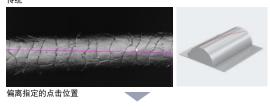
提供: 关西学院大学理工学部物理学科金子忠昭教授

非接触、非破坏、高精度地再现表面形状。可以在不损伤目标物的情况下测量高度、宽度、角度等。仅需获取 1 次数据,可多次重新测量任意位置。

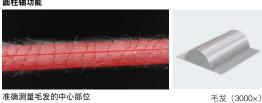
### 目标位置无偏差截面测量辅助工具

球中心部位、圆筒中央部位、最凹陷处等目视情况下难以明确掌握的部位,VK-X都可以准确地检测到。任何人都可以测量同一位置,从而抑制偏差。

### 传统

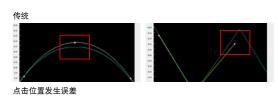


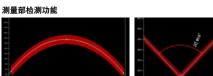
### 圆柱轴功能



### 准确测量获取的截面测量线 测量部检测功能

仅需点击截面波形即可完成测量。即使此时点击的位置 从线上偏离,也会自动补正测量位置,返回准确无误的 结果。

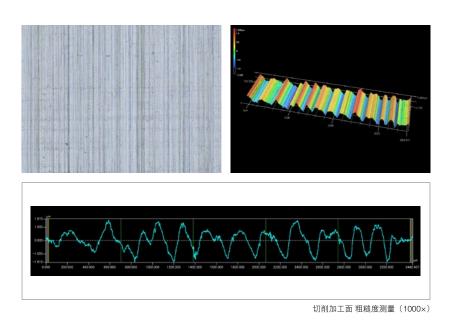




准确测量毛发的中心部位

# 粗糙度分析简单

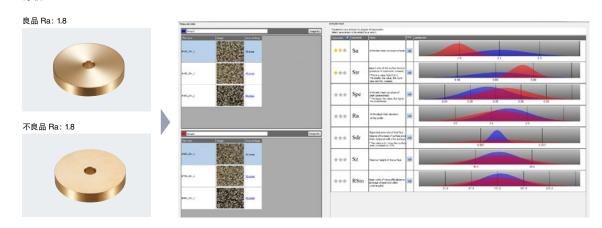
符合 ISO 标准。测量各种目标物的粗糙度



不但可以测量线粗糙度 (ISO 4287), 还可以测量面粗糙度 (ISO 25178)。通过读取到针无法触及的 微小的形状变化,实现了精密的测量。

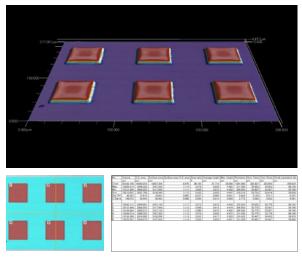
### 了解样品之间的粗糙度差异参数启发

使用 42 个参数,自动比较多个样品。自动将 Ra、Rz 等值的关系可视化。良品与不良品、加工法不同的样品等,迄今为止不知道以什么为标准定量化差异的目标物,现在可以在瞬间完成分析。各参数均附有说明,无论是谁都可以进行表面性状分析。



### 体积面积测量

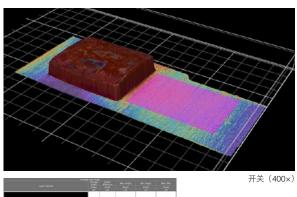
可对基准面的凹凸部体积、表面积、截面面积、面积率、平均高度、最大高度等进行测量,测量点最多可达 3000 个, 并可计算出平均值、最大值、最小值。

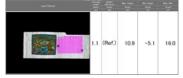


光阻剂(1000×)

### 平均高度差测量

测量指定区域相对于基准面的高度。此外,将检测出指定区域内的最低点和最高点,可根据其差分测量平面度。

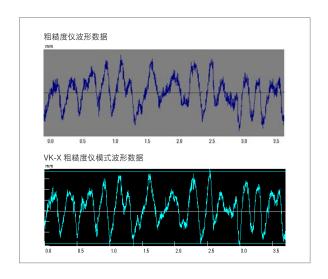




可对指定部分进行平面度测量

### 线粗糙度、多条线粗糙度测量(ISO 4287)

可以用符合 ISO 标准的形式进行粗糙度测量。使用光点直径 0.4 µm 的激光,超微小的形状也能准确读取。并配备接触式粗 糙度仪模式,可获取与以往测量值的相关性。

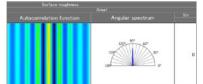


### 表面粗糙度测量(ISO 25178)

利用面的整体数据,可进行符合 ISO 标准的粗糙度测量。以往以线测量遗漏的区域,现在也能计算粗糙度,进行更加准确、稳定的测量。



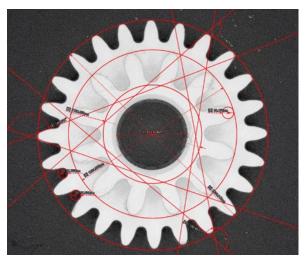
金属加工面 (400×)



可以非接触方式,对画面上的整个目标面进行粗糙度测量

### 平面测量

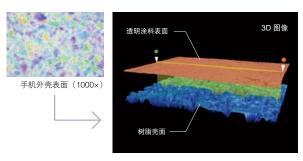
支持 XY 方向的各种测量,例如 2 点之间的距离、圆的直径、角度等。可以自动抽取目标物的轮廓,创建辅助线和交点,具备丰富的抑制偏差功能。

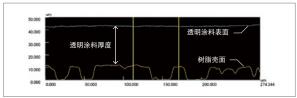


齿轮 外形测量(50×)

### 薄膜厚度测量

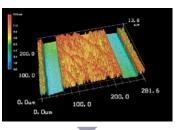
利用透明体最表面和背面两处返回反射光的特性,测量其厚度。 将最表面和背面整个 3D 化,根据其截面形状来测量薄膜厚度。

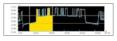




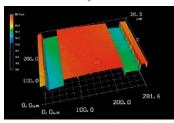
### 最表面测量

以往薄的透明体最表面和背面的反射光混在一起,难以测量。 VK-X 配备了"最表面测量模式",可以忠实地仅测量最表面。





传统 透明体将会接收背面反射, 因此无法测量透明体表面。



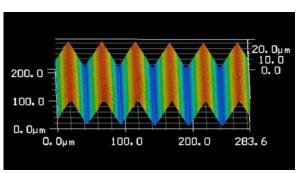


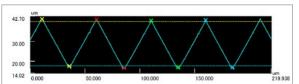
的反射。

光阻剂(1000×)

### 自动测量

利用反射光量的数据,可自动抽取最高点、端部等特征点。自动测量其高度、宽度等。在测量时仅需在设置好样品后单击对象即可,因此将非常适合用于检查过程。

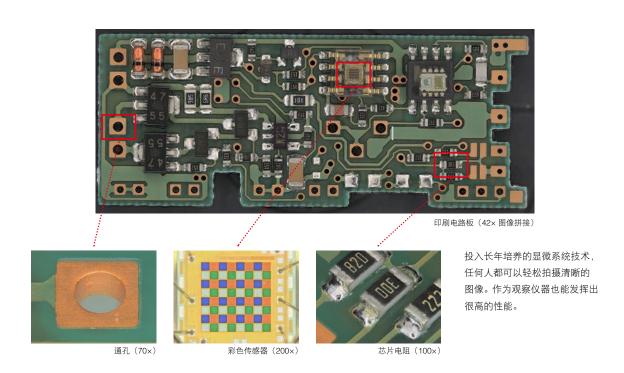




印刷电路板(100×、拼接[7张×6张])

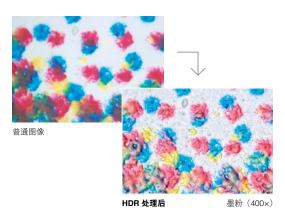
# 显微系统功能

带给所有人高质量的光学观察



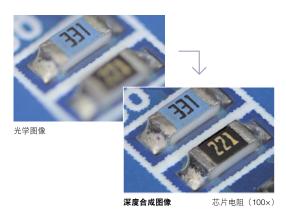
### 可观察以往无法观察到的对象 HDR 观察

合成不同亮度下拍摄的多张图像,生成一张高灰度级数据。通常观察不到的瑕疵、褶皱、颜色、阴影部分都可以清楚地观察到。



### 消除对焦模糊,可进行准确的判断 深度合成功能

对于用光学显微镜只能对一部分进行对焦的目标物,也可以在所有的视野中进行对焦观察。整体一目了然,分析效率更高。



# 匹敌 SEM 的高分辨率 / 高倍率

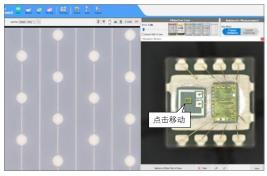
在大气中最大 28800 倍的观察力



# 高倍率下也不会迷失

### Auto-Navigation

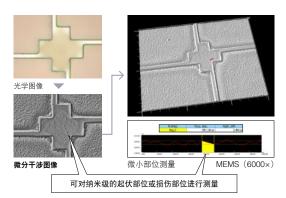
用于避免观察位置丢失的导航图像有了改进。仅需选择 想要观察的位置,移动载物台、切换镜头、调整焦点都 将自动完成。

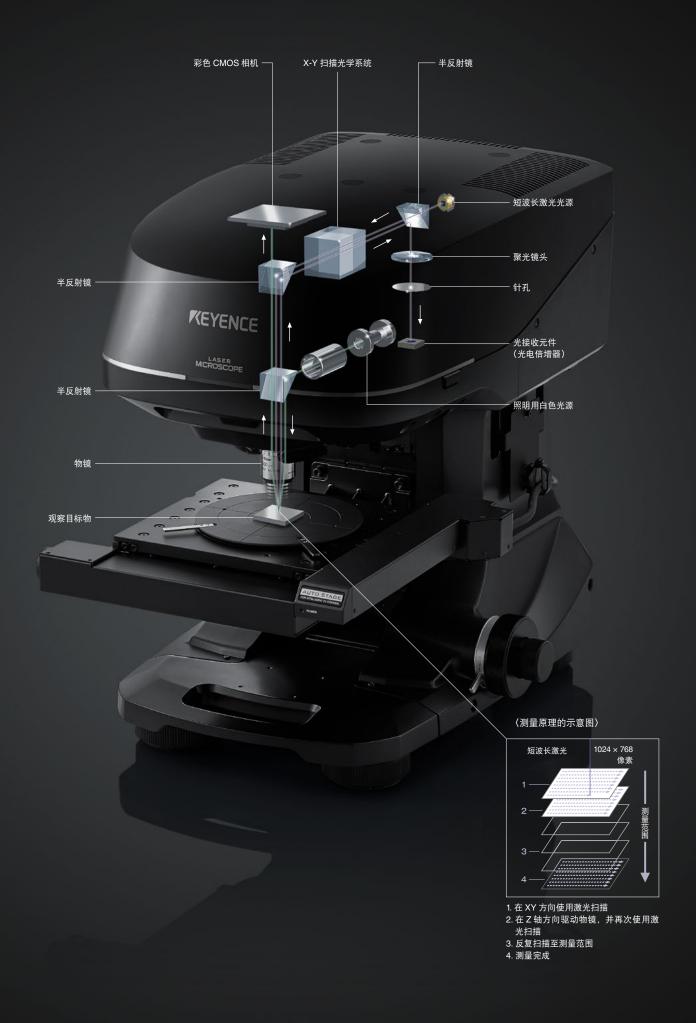


点击移动观察位置

### 可视化纳米级的起伏部位、损伤部位 C- 激光微分干涉

对于传统显微镜难以观测的纳米级的损伤部位或起伏部 位,可通过微分干涉进行可视化。可直接进行 3D 测量, 分析更加准确。





## 2 种 光 源

VK-X 结合使用了"激光光源"与"白色光源"2 种光源。使用激光向 XYZ 方向以静音方式超高速地扫描对象表面,可获取具有高水平分别率的图像,并实现了高度测量。还可使用白色光,如光学显微镜般获取样品表面的颜色信息。



【关于激光光源】VK-X 中备有紫色半导体激光 404 nm 和红色半导体激光 661 nm 两种光源。可根据客户的使用用途,提供充分发挥各波长特征的方案。

### 获 得 的 3 图 像

激光通过 XY 扫描光学系统,在扫描前对观察视野范围进行分割,最多可分割为 2048 × 1536 pixel。在测量高度范围内重复上述步骤,并对各像素的激光光量反射数据及颜色信息数据进行匹配。仅使用正确焦点位置的颜色信息。由此,可获取高分辨率、彩色、高低图像(信息)。







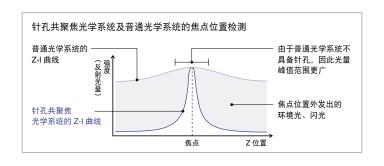
激光光量信息



高低信息

# 针孔共聚焦光学系统

VK-X 采用针孔共聚焦光学系统。可通过极小针孔,完全排除焦点位置外产生的反射光、环境光,并将反射光量最多的位置识别为正确高度。不仅可通过高精度定位实现高精度测量,还可对排除了散焦部分的图像进行累积,从而实现高精细/高倍率观察。



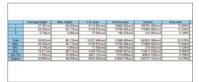
### 分析功能扩展模块 VK-H1XP

若样品需通过模式匹配进行位置补正处理,或测量对象为球体、平面体的斜面角度等时,将根据测量需求,提供分析功能扩展模块。由于 可对更多的样品进行高自由度分析,因此分析操作的效率得以提升。

### [凹凸部位测量]

可对指定高度阈值的上部(凸部)或下部(凹 部)范围,在各个空间上进行分割,并针对各 范围进行测量。

# 凹、凸部位测量



BLIMP (2000x)

### [球形、平面角度测量]

在指定范围内, 可通过近似圆, 自动抽取半径。 由于是自动抽取而无需目测, 故可避免测量偏 差。

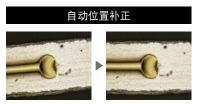
# 球形测量

	Measurement m	Setting method	Radius	Comment
1	Sphere	Rectangle	146.532um	
- 3	Sphere	Rectangle	142.829um	
- 3	Sphere	Rectangle	144.667um	
- 4				
- 5				
Total			434.027um	
Max.			146.532um	
Min.		142.829um		
Ave.			144.676um	
Std. DV			1.512um	
3sigma			4.535um	

微透镜(1000×)

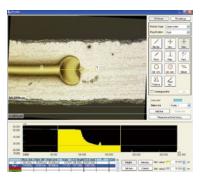
### [位置补正功能]

事先注册标准样品,并在以模版打开其他图像 时自动进行位置补正, 以使该图像位置与注册 样品的位置相同。



自动对倾斜图像

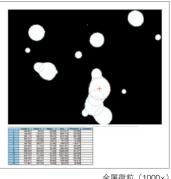
进行位置补正



### 分析微粒使用的模块 VK-H1XG

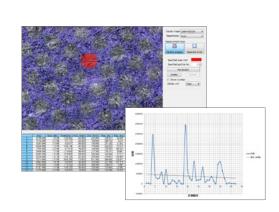
若目标物在视野范围内具备多种微粒(圆)形状,则可自动进行"数量"、"微 粒直径"、"长短轴"、"面积"、"面积率"测量。也可自动实施"圆形分离"、"扩 展"、"融合"等处理。





金属微粒(1000×)

可根据目标物表面的精准 3D 数据进行微粒分析。也 可将结果输出至 Microsoft®Excel® 等表计算软件中, 轻松地进行统计分析处理。



### VK 垫块

在显微系统背面安装高硬度专用垫块后,可测量大型样品。



### 电动载物台

使用高精度电动 XY 载物台后,可精准地实现导航、示范教学测量及大范围图像拼接测量。



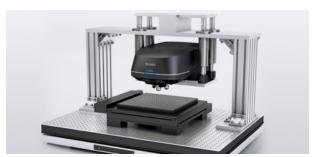
### 300 mm 晶片载物台

可以观察和分析整个 300 mm 晶片,而不会有盲点。可直接安装于测量部。有关其他样品载物台的尺寸,请咨询基恩士。



### 超大型样品载物台

为对大型印刷电路板等样品顺利实施测量,我们将根据客户需求,推荐载物台的应用。



\* 我司不负责订做销售特殊规格载物台

### 丰富的镜头阵容

可提供 2.5 倍至 150 倍的 VK-X 用镜头。基恩士提供各类镜头,包括长动作距离镜头、长宽比较高的目标物用镜头等,且镜头出厂前将接受特殊调整。





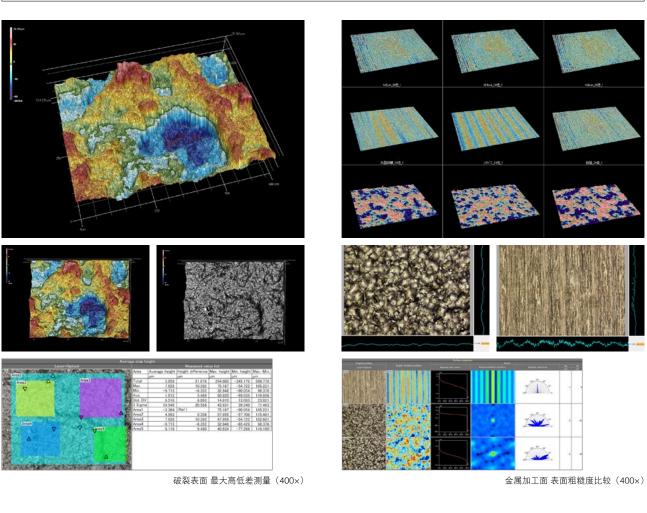
折射少、色差小的萤石

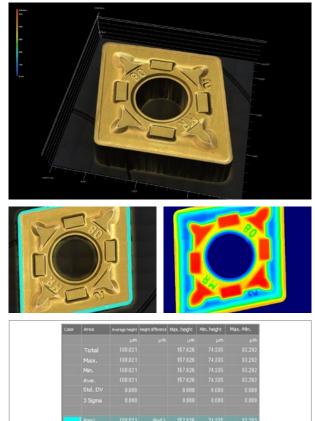
对于需充分取得工作距离、留出宽裕空间放置样本的长动作距离测量,亦有齐全的产品阵容。



长动作距离镜头一例	显示器倍率	动作距离
标准 5 倍镜头	120 倍	22.5 mm
超长距离 20 倍镜头	480 倍	20.5 mm
超长距离 50 倍镜头	1200 倍	13.8 mm
超长距离 100 倍镜头	2400 倍	4.7 mm

### 汽车、金属

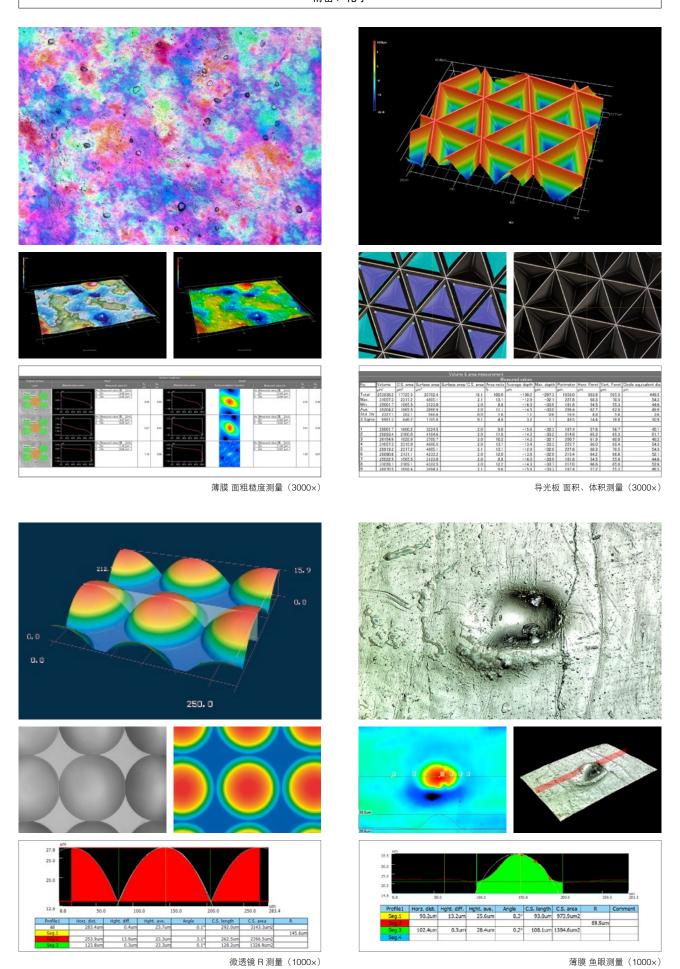


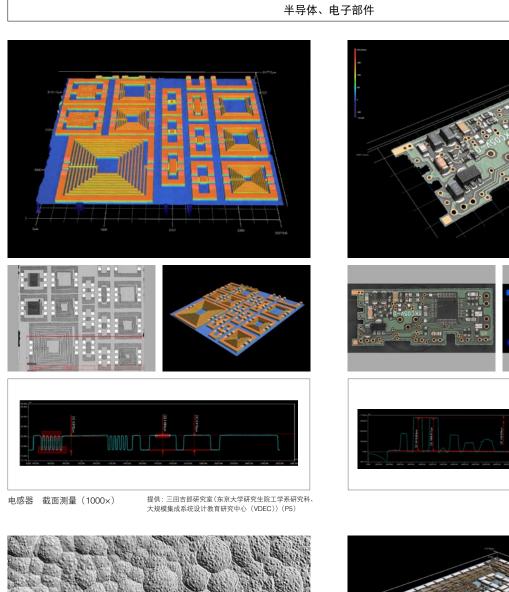


钻头 基座的 R 测量(100×)

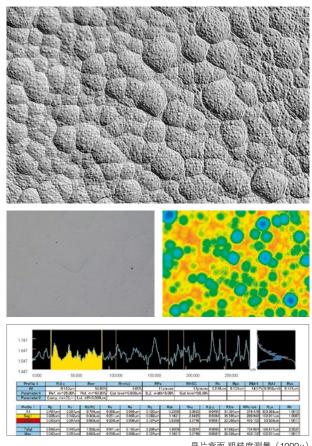
舍弃式刀片 磨损评估(100×)

### 精密、化学

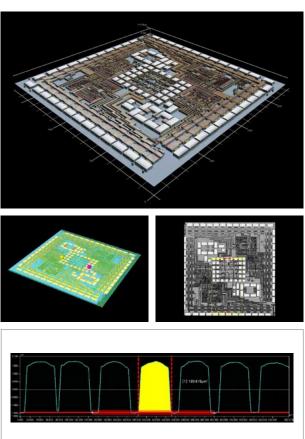




印刷电路板(42× 图像拼接)



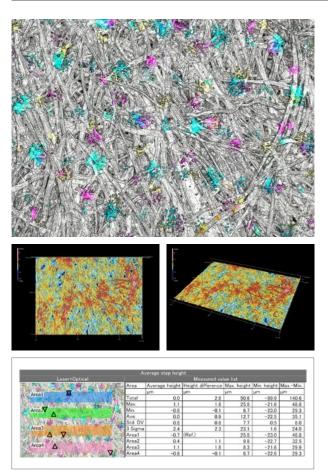
晶片背面 粗糙度测量(1000×)



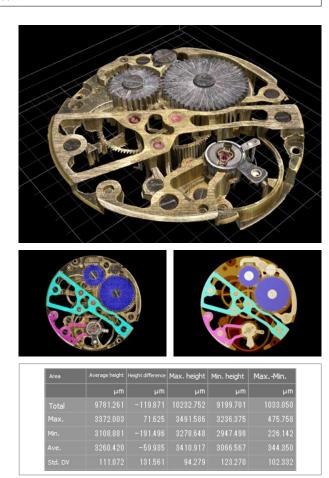
MEMS 截面面积测量 (1000×)

提供:Matthieu Denoual 博士 (GREYC/CNRS, ENSI de Caen, France) 与三田吉郎研究室 (东京大学研究生院工学系研究科、大規模集成系统设计教育研究中心(VDEC))(封面)

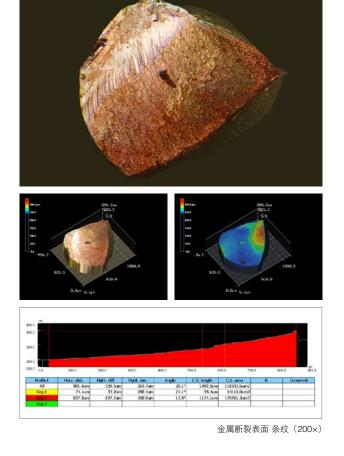
### 其他各类

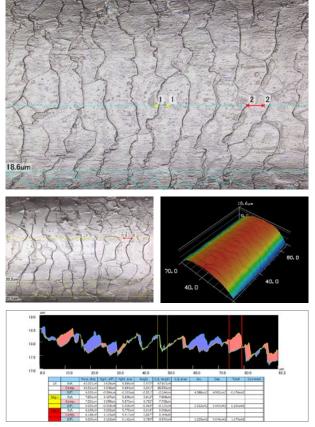


纸表面 平面度 / 平坦度测量(100×)



钟表机心(100× 图像拼接)





毛发 毛鳞片比较(3000×)

### 产品阵容

16 bit 形状测量激光显微系统 控制器 VK-X1000 测量头 VK-X1100 底座 (电动/手动) VK-D1/VK-S1

紫色半导体激光 波长 404 nm

显示分辨率 0.5 nm



16 bit 形状测量激光显微系统 控制器 VK-X1000 测量头 VK-X1050 底座 (电动/手动) VK-D1/VK-S1

红色半导体激光 波长 661 nm

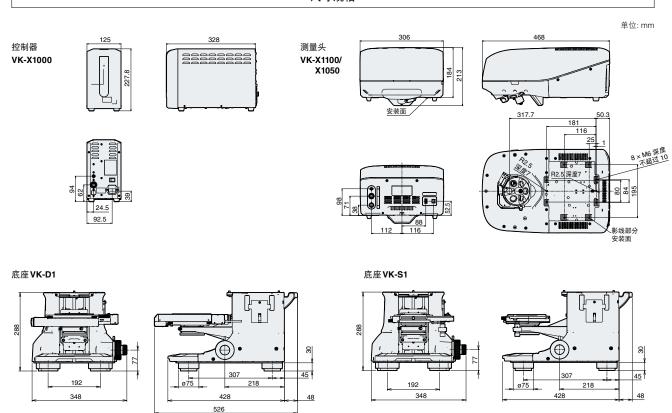
显示分辨率 5 nm



### 系统构成图



### 尺寸规格



### 规格

### ■基本功能

型号 控制器 / 测量头			VK-X1000/X1100	VK-X1000/X1050	
综合倍率 *1			28800 倍以下		
视野(最小视野范围)			11 µm 至 7398 µm		
帧率 *2(激光	光测量速度)		4 至 125 Hz	z、7900 Hz	
	光学系统		针孔共聚焦光学系统、聚焦变化		
测量原理	光接收元件		16 bit 感应光电倍增器 超高精细彩色 CMOS		
	扫描方式(常规测量时及图像拼接时)		自动上下限设定功能 高速光量最佳化功能(AAGII)反射光量不足补充功能(双扫描)		
	显示分辨率		0.5 nm	5 nm	
	线性标尺		0.5 nm	5 nm	
÷ ~ >= =	动态量程(来自工件的光接收量的适用幅度)		16 bit		
高度测量	重复精度σ	激光共聚焦	20 倍 40 nm、50 倍 12 nm	20 倍 40 nm、50 倍 20 nm	
	里友相及 0	聚焦变化	5 倍 500 nm、10 倍 100 nm、20 倍 50 nm、50 倍 20 nm	5 倍 500 nm、10 倍 100 nm、20 倍 50 nm、50 倍 30 nm	
	高度数据获取范围		70 万步骤		
宽度测量	显示分辨率		1 nm	10 nm	
	重复精度 3 σ	激光共聚焦	20 倍 100 nm、50 倍 40 nm	20 倍 100 nm、50 倍 50 nm	
	里友相及 30	聚焦变化	5 倍 400 nm、10 倍 400 nm、20 倍 120 nm、50 倍 50 nm	5 倍 400 nm、10 倍 400 nm、20 倍 120 nm、50 倍 65 nm	
XY 载物台	手动 运行范围		70 mm >	× 70 mm	
结构	电动 运行范围		100 mm × 100 mm		
观察	加安因儉		超高精细彩色 CMOS 图像 16 bit 激光彩色共焦点图像 共焦点 + ND 滤波器光学系统 C- 激光微分干涉图像		
	照明		环状照明 同轴落射照明		
'm  = m	波长		紫色半导体激光 404 nm	红色半导体激光 661 nm	
测量用	最大输出		1 mW		
激光光源	激光产品		2 类激光产品 (GB7247.1)		
<b>+</b> 25	电源电压		100 至 240 VAC、50/60 Hz		
电源	消耗功率		150 VA		
	测量头		约 13.0 kg		
重量	底座		约 16.0 kg(安装电动载物台时为 +2.5 kg)		
	控制器		约 3.0 kg		

### ■测量镜头部

物镜	型号	W/D (mm)	视野	VK-X1100	VK-X1050
2.5 倍	971676	8.8	675 × 506 μm 至 7398 × 5545 μm	选购件	选购件
5 倍	971673	22.5	337 × 253 μm 至 3699 × 2773 μm	随机附带	随机附带
10 倍	972003	16.5	168 × 126 μm 至 1849 × 1386 μm	随机附带	随机附带
20 倍	972005	3.1	84 × 63 μm 至 924 × 693 μm	随机附带	随机附带
50 倍	972007	0.54	33.7 × 25.2 μm 至 370 × 277 μm	无符合镜头	随机附带
100 倍	972008	0.35	16.8 × 12.6 μm 至 185 × 138 μm	无符合镜头	选购件
50 倍 APO	971992	0.35	33.7 × 25.2 μm 至 370 × 277 μm	随机附带	选购件
100 倍 APO	971947	0.32	16.8 × 12.6 μm 至 185 × 138 μm	选购件	选购件
150 倍 APO	971950	0.2	11 × 8.3 μm 至 123 × 92 μm	选购件	选购件
长距离 20 倍	971799	11.0	84 × 63 μm 至 924 × 693 μm	选购件	选购件
长距离 50 倍	971589	8.7	33.7 × 25.2 μm 至 370 × 277 μm	选购件	选购件
长距离 100 倍	971595	2	16.8 × 12.6 μm 至 185 × 138 μm	选购件	选购件
超长距离 20 倍	972006	20.5	84 × 63 μm 至 924 × 693 μm	选购件	选购件
超长距离 50 倍	971765	13.8	33.7 × 25.2 μm 至 370 × 277 μm	选购件	选购件
超长距离 100 倍	971769	4.7	16.8 × 12.6 μm 至 185 × 138 μm	选购件	选购件
更换镜头				可通过戶	用户更换

<sup>\*123</sup> 寸显示器画面上的倍率(全屏显示器时)。 \*2 测量模式 / 测量品质 / 镜头倍率的组合中,取最快的一组组合时。线扫描的情况下,测量间距小于 0.1 μm 时。

<sup>\*</sup> Microsoft®Excel® 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标或者商标。



# KEYENCE 基恩士

www.keyence.com.cn

### 基恩士(中国)有限公司 最新发售情况,请咨询就近的基恩士

200120 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心7楼 电话:+86-21-5058-6228 传真:+86-21-5058-7178 【关于产品的咨询, 请致电】 电话: +86-21-3357-1001 传真: +86-21-6496-8711

电话:+86-10-8447-5835 传真:+86-10-8447-5370 上海前滩 电话:+86-21-6106-0050 传真:+86-21-6106-0061 天 电话:+86-22-8319-1775 传真:+86-22-8319-1578 杭州 电话:+86-571-2827-3290 传真:+86-571-2827-3291 大青南 电话:+86-411-3986-9011 传真:+86-411-3986-9010 电话:+86-574-2778-5666 传真:+86-574-2799-9299 连 宁 波 电话:+86-532-6677-7110 传直:+86-532-8571-8182 武 汉 电话:+86-27-8771-7558 传直:+86-27-8771-7557 寍 京 电话:+86-25-8322-9577 传真:+86-25-8322-6277 重庆 电话:+86-23-6558-1990 传真:+86-23-6558-1991 无 锡 电话:+86-510-6662-8800 传真:+86-510-6605-6890 州 电话:+86-20-3878-1155 传真:+86-20-3878-0199 苏州一 电话:+86-512-8588-3900 传真:+86-512-8588-3901 深圳东 电话:+86-755-2588-2550 传真:+86-755-8247-8972 苏州二 电话:+86-512-6809-8612 传真:+86-512-6809-8613 电话:+86-769-2290-6690 传真:+86-769-2290-3390 东 萘 电话:+86-512-5527-8711 传直:+86-512-5527-8712 深圳西 传直:+86-755-8627-1027 昆山 电话:+86-755-2588-2551 上海虹桥 电话:+86-21-3357-1001 传真:+86-21-6496-8711

基恩士(香港)有限公司 香港九龍紅磡都會道10號都會大廈26樓2606-07室

电话:+852-3104-1010 传真:+852-3104-1080



最新信息 登录微信关注 基恩十公众号

